

Д. ф.-м. н. Л. А. КОСЯЧЕНКО, д. ф.-м. н. И. М. РАРЕНКО,  
А. В. МАРКОВ, к. ф.-м. н. С. Э. ОСТАПОВ

Украина, Черновицкий национальный университет  
E-mail: microel@chdu.cv.ua

Дата поступления в редакцию

30. 01. 2001 г.

Оппонент д. ф.-м. н. Е. И. СЛИНЬКО

## ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК $n^+$ — $p$ -ПЕРЕХОДА НА ОСНОВЕ УЗКОЗОННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

*Рассмотрены особенности распределения объемного заряда, напряженности электрического поля и потенциала в  $p$ — $n$ -переходе в узкозонном полупроводнике.*

Для детектирования инфракрасного излучения в спектральной области 8—14 мкм используются диодные структуры на основе HgCdTe с  $p$ — $n$ -переходами, содержащими сильно легированную  $n$ -область, т. е.  $n^+$ — $p$ -переходы [1]. Имея в виду намного большую диффузионную длину электронов по сравнению с дырками,  $n^+$ — $p$ -структуры следует считать наиболее пригодными и при использовании других родственных материалов, в частности, HgMnTe [2]. Характеристики таких переходов, образующихся при ионной имплантации или ионном травлении подложки (эпитаксильного слоя)  $p$ -типа проводимости [1—3], обстоятельно проанализированы теоретически с учетом различных механизмов тока [1, 2]. Для описания происходящих процессов обычно используются разработанные для  $p$ — $n$ -переходов хорошо известные модели [4, 5].

Между тем детальные исследования электрических характеристик  $Hg_{1-x}Mn_xTe$  (состава  $x \approx 0,1$ , шириной запрещенной зоны  $E_g \approx 0,1$  эВ)  $n^+$ — $p$ -переходов выявляют существенные особенности, не укладывающиеся в эти модели: вольт-амперная характеристика при прямом смещении отклоняется от зависимости  $I \sim \exp(eV/2kT)$ , характерной для рекомбинационного тока, диффузионный ток ( $I \sim \exp(eV/kT)$ ) (где  $e$  — заряд электрона,  $V$  — напряжение смещения,  $k$  — постоянная Больцмана,  $T$  — температура) проявляется при слишком больших прямых смещениях, отношение прямого тока к обратному обычно не превышает  $10^2$  и др. [3, 6].

Представленные в настоящей работе результаты показывают, что наблюдаемые особенности электрических характеристик  $n^+$ — $p$ -диодов объяснимы, если использовать модель перехода, учитывающую вырождение  $n^+$ -области и обусловленные этим эффектом распределения объемного заряда, потенциала и напряженности электрического поля в области пространственного заряда. Это представляется актуальным, поскольку в полупроводниках типа  $Hg_{1-x}Cd_xTe$ ,  $Hg_{1-x}Mn_xTe$  с шириной запрещенной зоны около 0,1 эВ

(гранична длина волны  $\sim 12$  мкм) эффективная масса электронов примерно на два порядка меньше массы свободного электрона, а заметное вырождение электронного газа в зоне проводимости наблюдается уже при концентрации электронов  $n \approx 10^{16}$  см $^{-3}$ .

### Распределение объемного заряда и напряженности электрического поля в $n^+$ — $p$ -переходе на основе узкозонного полупроводника

Рассмотрим переход на границе электронного полупроводника с концентрацией доноров  $N_d$  в области  $x < 0$  и дырочного — с концентрацией акцепторов  $N_a$  в области  $x > 0$ . Предполагаемое ступенчатое распределение примеси адекватно описывает мелкие диффузионные, ионно-имплантированные и эпитаксиальные переходы [1, 2, 4], а также образующиеся при ионном травлении  $p$ -HgMnTe [3].

Итак, в приближении ступенчатого перехода в области  $x < 0$  ионизированные доноры создают объемный заряд  $eN_d$ , а в области  $x > 0$  ионизированные акцепторы создают объемный заряд  $eN_a$  (если  $n$ - или  $p$ -области представляют собой компенсированные полупроводники,  $N_d$  и  $N_a$  заменяются концентрацией нескомпенсированной примеси). В случае широкозонного полупроводника обычно полагается, что концентрация основных носителей с обеих сторон от границы раздела быстро убывает при углублении в область  $p$ — $n$ -перехода (концентрация носителей изменяется на порядок при изменении потенциальной энергии на 2,3  $kT$ ), и поэтому плотности объемного заряда слева и справа от  $p$ — $n$ -перехода можно считать независящими от координаты и равными соответственно  $eN_d$  и  $-eN_a$  (примеси предполагаются мелкими, а температура не очень низкой). В случае узкозонного полупроводника (в данном случае имеется в виду  $E_g \approx 0,1$  эВ), когда высота потенциального барьера (диффузионный потенциал) в  $p$ — $n$ -переходе  $\phi(x)$  намного меньше, вкладом свободных носителей (основных) пренебрегать нельзя. Если  $p$ — $n$ -переход, кроме того, несимметричный, а тем более, если одна из областей является вырожденной, необходимо учитывать также вклад неосновных носителей, которые заходят в менее легированную область из сильнее легированной области.

С учетом сказанного уравнения Пуассона для  $n^+$ - и  $p$ -областей в одномерном случае имеют вид:

## ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

$$\frac{d^2\Phi}{dx^2} = \frac{e^2[N_d - n(x) + p(x)]}{\epsilon\epsilon_0} \text{ при } x < 0, \quad (1)$$

$$\frac{d^2\Phi}{dx^2} = -\frac{e^2[N_a - p(x) + n(x)]}{\epsilon\epsilon_0} \text{ при } x > 0, \quad (2)$$

где  $e$  — подразумевается абсолютная величина заряда электрона;

$\epsilon$  — относительная диэлектрическая проницаемость полупроводника;

$\epsilon_0$  — электрическая постоянная;

$n(x)$  и  $p(x)$  — распределения концентрации электронов и дырок с координатой.

Отсчитывая энергию  $E$  от дна зоны проводимости в нейтральной части  $n^+$ -области и обозначая энергию Ферми через  $E_{Fn}$ , для концентрации электронов в зоне проводимости можно записать:

$$n(x, V) = \int_0^\infty \frac{\rho_c(E)dE}{\exp\left(\frac{E-E_{Fn}+\phi(x, V)}{kT}\right)+1}, \quad (3)$$

где  $V$  — напряжение смещения,  $\rho_c(E)$  — плотность состояний в зоне проводимости, непараболичность которой учтем, используя закон дисперсии в широко применяемой модели Кейна [7]

$$\rho_c(E) = \frac{\sqrt{2}m_e^{3/2}}{\pi^2\hbar^3} E^{1/2} \left(1 + \frac{E}{E_g}\right)^{1/2} \left(1 + 2\frac{E}{E_g}\right), \quad (4)$$

где  $m_e$  — эффективная масса электрона на дне зоны проводимости (остальные обозначения общепринятые).

Поскольку концентрация дырок в  $p$ -области рассматриваемых диодов обычно близка к  $10^{16}$  см $^{-3}$  (во всяком случае, не превышает  $10^{17}$  см $^{-3}$ ), а эффективная масса дырки  $m_h \approx 0,5m_0$  ( $m_0$  — масса электрона в вакууме), эффектами вырождения в валентной зоне можно пренебречь и для концентрации свободных дырок записать:

$$p(x, V) = \frac{N_v}{\exp\left(\frac{E_{Fp} + \phi_0 - eV - \phi(x, V)}{kT}\right)+1}, \quad (5)$$

где  $E_{Fp}$  — энергетическое расстояние уровня Ферми от потолка валентной зоны в объеме  $p$ -области;

$\phi_0$  — высота барьера в  $p-n$ -переходе при  $V=0$ ;

$N_v$  — эффективная плотность состояний в валентной зоне, равная  $2(m_h kT / 2\pi\hbar^2)^{3/2}$  (для простоты рассматривается только один тип дырок).

Уравнения Пуассона (1) и (2) с учетом (3)–(5) решались численным методом Рунге–Кутта [8] как система дифференциальных уравнений первого порядка

$$\frac{1}{e} \frac{d\phi}{dx} = F(x, \phi), \quad (6)$$

$$\frac{dF}{dx} = \frac{1}{\epsilon\epsilon_0} Q(x, \phi) \quad (7)$$

для напряженности электрического поля  $F(x, V)$  и плотности объемного заряда  $Q(x, V)$ , соответственно.

При этом в качестве граничных условий для решения уравнений служили следующие предположения:

- равенство нулю напряженности электрического поля в объемной части полупроводника;

- в точке  $x=0$  оба уравнения должны давать одинаковые значения как потенциала, так и напряженности электрического поля;

- разница между значениями потенциалов в объемной части  $n$ - и  $p$ -областей (высота барьера в переходе) определялась как разница положений уровня Ферми в этих областях при заданных концентрациях свободных носителей.

Расчеты проведены для  $T=77$  К (поскольку фотодиоды для спектральной области 8–14 мкм обычно работают при температуре жидкого азота), значение диэлектрической проницаемости было принято равным 17 [1, 2].

На рис. 1, а представлено найденное распределение объемного заряда  $Q$ , т. е. величины  $e[N_d - n(x) + p(x)]$  для  $n$ -области и  $-e[N_a - p(x) + n(x)]$  для  $p$ -области, а также напряженности электрического поля  $F$ . Расчет производился для симметричного  $p-n$ -перехода при  $N_d = N_a = 10^{16}$  см $^{-3}$  и полупроводнике с шириной запрещенной зоны 1, 0,3 и 0,1 эВ, а эффективные массы электронов и дырок приняты для начала равными  $m_e = m_h = 0,55m_0$ . Как и можно было ожидать, для  $E_g = 1$  эВ плотность объемного заряда по обе стороны от границы раздела на большей части обедненного слоя оказалась постоянной, и только на его краях плавно изменяющейся (объемная плотность заряда  $1,6 \cdot 10^{-3}$  Кл·см $^{-3}$  соответствует заряду однократно ионизованных примесей с концентрацией  $10^{16}$  см $^{-3}$ ). Для  $E_g = 0,3$  эВ переходная область охватывает уже значительную часть области пространственного заряда, а для  $E_g = 0,1$  эВ постоянство объемного заряда вообще не наблюдается.

Таким образом, сделанное предположение об усиливающейся роли свободных носителей в формировании объемного заряда в  $p-n$ -переходах в узко-зонном полупроводнике подтверждается. Более того, для  $E_g \approx 0,1$  эВ роль свободных носителей оказывается преобладающей, как это видно из рис. 1. Как уже отмечалось, это обусловлено малой контактной (по сравнению с диодами на широкозонных полупроводниках) разностью потенциалов. Поэтому решение уравнений (1) и (2) для  $E_g = 0,1$  эВ при обратном смещении  $V=-1$  В приводит к такому же «профилю» объемного заряда, как и для случая  $E_g = 1$  эВ при  $V=0$ . При прямом смещении диода, когда барьер понижается, влияние свободных носителей, естественно, усиливается.

Изменению характера распределения объемного заряда при уменьшении  $E_g$  сопутствует видоизменение распределения напряженности электрического поля в  $p-n$ -переходе. Как видно из рис. 1, для  $E_g = 1$  эВ напряженность поля  $F$  линейно уменьшается по мере удаления от границы раздела (хорошо известный факт). Для  $E_g = 0,3$  эВ линейный участок сужается, а для  $E_g \approx 0,1$  эВ зависимость  $F(x)$  претерпевает качественные изменения. (В отличие от зависимости  $F(x)$  «деформация» кривых  $\phi(x)$  прояв-

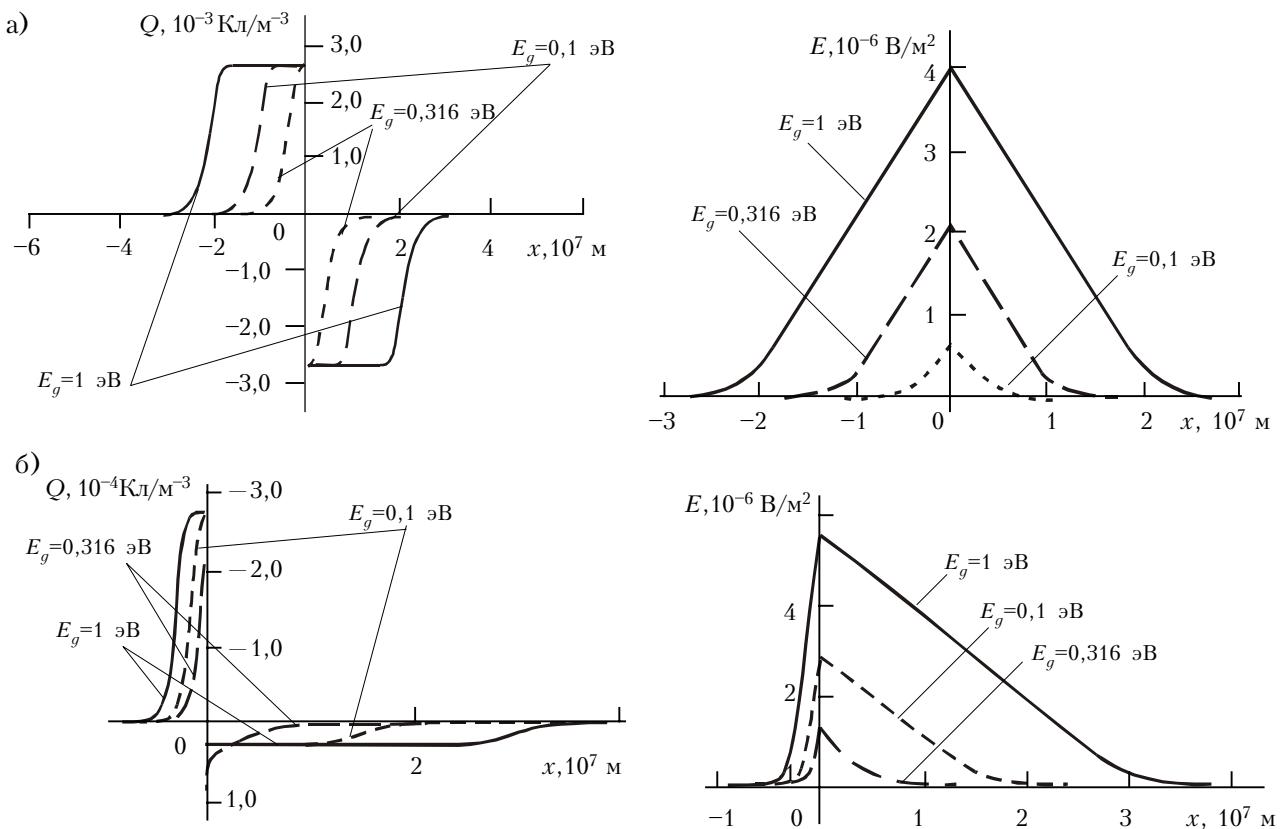


Рис. 1. Распределение плотности объемного заряда и напряженности электрического поля для (а) симметричного ( $N_a = N_d = 10^{16} \text{ см}^{-3}$ ) и (б) несимметричного ( $N_a = 10^{16} \text{ см}^{-3}$ ,  $N_d = 10^{17} \text{ см}^{-3}$ )  $p-n$ -перехода при трех значениях ширины запрещенной зоны (77 К)

ляется не столь наглядно, и поэтому они на рисунке не представлены.)

Обсуждаемые особенности проявляются также и в *несимметричном*  $p-n$ -переходе (рис. 1, б). При уменьшении  $E_g$  участки с постоянной плотностью объемного заряда, а значит, с линейной зависимостью напряженности электрического поля и квадратичной зависимостью потенциала от координаты, сужаются как в  $p$ -области, так и в сильнее легированной  $n$ -области. Качественное отличие от симметричного перехода заключается в том, что для узкозонного полупроводника ( $E_g = 0,1 \text{ эВ}$ ) в слое, прилегающем к границе  $x=0$  со стороны слабо легированной  $p$ -области, плотность объемного заряда резко возрастает в результате перехода электронов из  $n$ -области (что и оговаривалось выше). Этот эффект усиливается при большем различии  $N_d$  и  $N_a$ , что вполне может реализоваться в  $\text{HgCdTe}$  и  $\text{HgMnTe}$   $n^+ - p$ -переходах.

Таким образом, перенесение модели  $p-n$ -перехода в широкозонном полупроводнике на диоды в узкозонных полупроводниках не вполне корректно, особенно если это касается процессов, зависящих от хода потенциала и распределения напряженности электрического поля в области пространственного заряда (генерация-рекомбинация, туннелирование и т. п.).

### Влияние вырождения $n$ -области

Чтобы выявить изменения, обусловленные уменьшением ширины запрещенной зоны полупроводника,

эффективные массы электронов и дырок в представленных выше расчетах были приняты равными. На самом деле при сужении  $E_g$  эффективная масса электрона  $m_e$  быстро уменьшается, так что соотношение  $m_e = 0,01m_0$  для рассматриваемых полупроводников можно считать типичным. Одновременно с уменьшением  $m_e$  резко уменьшается плотность состояний в зоне проводимости, из-за чего, как уже отмечалось, вырождение электронного газа наблюдается при необычно низких для широкозонного полупроводника концентрациях носителей.

Сильное вырождение электронов в  $n$ -области диодной структуры объясняет экспериментальный факт, что высота барьера  $\Phi_0$  в  $n^+ - p$ -переходе в 2–3 раза превышает ширину запрещенной зоны полупроводника [3, 6]. Действительно, в этом случае

$$\Phi_0 = E_g - E_{Fp} + E_{Fn}. \quad (9)$$

Значение  $E_{Fp}$ , согласно (5), составляет при  $p = 3 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ , 77 К примерно 0,025 эВ, а  $\Phi_0 = 0,25 \text{ эВ}$  при концентрации электронов в  $n$ -области, несколько превышающей  $10^{18} \text{ см}^{-3}$  (см. **рис. 2**), что вполне достижимо.

С учетом сказанного на рис. 2 представлены результаты решения уравнения Пуассона (1) и (2) для полупроводника с шириной запрещенной зоны 0,1 эВ и параметрами, типичными для  $\text{HgCdTe}$  или  $\text{HgMnTe}$   $p-n$ -переходов ( $m_h = 0,55m_0$ ,  $m_e = 0,01m_0$ ,  $N_a = 10^{16} \text{ см}^{-3}$ ) при трех значениях концентрации доноров —  $10^{16}$ ,  $10^{17}$  и  $10^{18} \text{ см}^{-3}$ . Как видно из рисун-

## ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

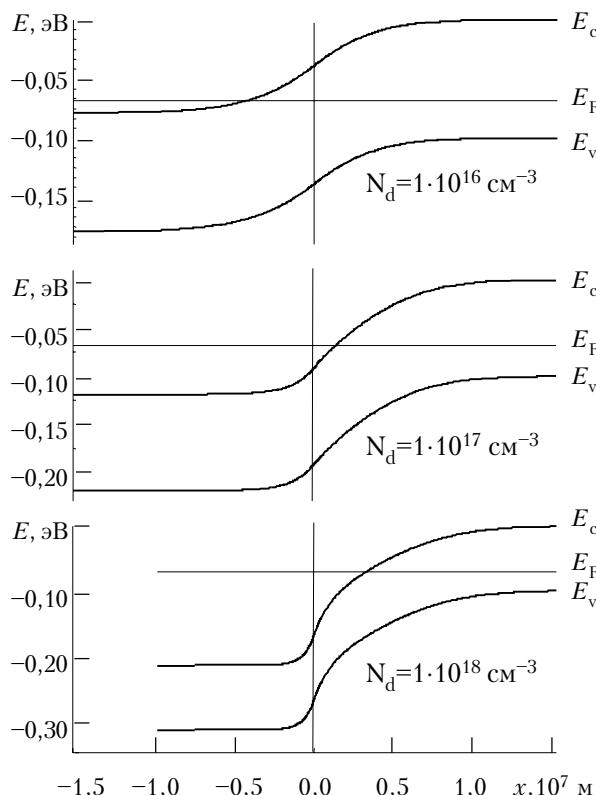


Рис. 2. Рассчитанные энергетические диаграммы перехода в  $p$ -подложке ( $E_g=0,1$  эВ) с концентрацией акцепторов  $10^{16}$  см $^{-3}$  для  $m_e=m_h=0,55m_0$  и различных концентрациях доноров (77 К)

$E_F$  – уровень Ферми;  $E_c$  – дно зоны проводимости;  $E_v$  – потолок валентной зоны

ка, при  $N_d=10^{16}$  см $^{-3}$  энергетическая диаграмма перехода напоминает таковую для ступенчатого  $p$ – $n$ -перехода в широкозонном полупроводнике с несколько вырожденной  $n$ -областью. Однако при  $N_d=10^{17}$  и  $10^{18}$  см $^{-3}$  энергетическая диаграмма перехода сильно видоизменяется. Если в несимметричном  $n^+$ – $p$ -переходе в широкозонном полупроводнике перепад потенциала, приходящийся на сильно легированную область, составляет  $N_a/(N_a+N_d)$ -ю долю, т. е. очень малую часть высоты барьера [4], то в рассматриваемом случае это не так. Как видно из рисунка, и при  $N_d=10^{18}$  см $^{-3}$ , и при  $10^{17}$  см $^{-3}$  (как, впрочем, и при  $N_d=10^{16}$  см $^{-3}$ ) на  $n^+$ -область приходится примерно одинаковое падение потенциала, равное  $\sim 0,04$  В. Не менее важно и то, что в  $n^+$ – $p$ -переходе в результате

перехода электронов из  $n^+$ -области становится вырожденной и  $p$ -область, прилегающая к металлографической границе раздела.

\*\*\*

Таким образом, распределение плотности объемного заряда, напряженности электрического поля и потенциала в  $p$ – $n$ -переходе в широкозонном полупроводнике претерпевает качественные изменения при переходе к полупроводнику с шириной запрещенной зоны, пригодному для детектирования инфракрасного излучения в атмосферном окне 8–14 мкм. Эти изменения, обусловленные влиянием основных носителей, дополняются существенным вкладом неосновных носителей в несимметричном  $p$ – $n$ -переходе с вырожденной  $n^+$ -областью. В результате плотность объемного заряда перестает быть постоянной, зависимость напряженного электрического поля линейна, а потенциал становится квадратично зависящим от координаты.

Полученные результаты могут быть использованы для вычисления токов, проходящих через барьер, и, далее, с учетом всех возможных механизмов переноса, – диффузионного сопротивления диода при нулевом смещении, ключевого параметра детектора инфракрасного излучения. Эти проблемы, однако, требуют отдельного рассмотрения.

### ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Rogalski A. Analysis of the  $R_0A$  product in  $n^+$ – $p$   $Hg_{1-x}Cd_xTe$  photodiodes // Infrared Phys. – 1988. – Vol. 28, № 3. – P. 139–153.
- Rogalski A.  $Hg_{1-x}Mn_xTe$  as a new infrared detector material // Ibid. – 1991. – Vol. 31, N 2. – P. 117–166.
- Kosyachenko L. A., Rarenko I. M., Sun Weiguo, Lu Zheng Xiong. Charge transport mechanisms in  $HgMnTe$  photodiodes with ion etched  $p$ – $n$  junctions // Solid-State Electron. – 2000. – Vol. 44, N 7. – P. 1197–1202.
- Sze M. Physics of semiconductor devices. – New York: Wiley-Interscience, 1981.
- Пикус Г. Е. Основы теории полупроводниковых приборов. – М.: Наука, 1965.
- Kosyachenko L. A., Ostapov S. E., Sun Weiguo. Special features of generation-recombination processes in  $p$ – $n$  junctions based on the  $HgMnTe$  // Semiconductors. – 2000. – Vol. 34, N 6. – P. 668–670.
- Kane E. O. Band structure of indium antimonide // J. Phys. Chem. Solids. – 1957. – Vol. 1. – P. 249–261.
- Данилина Н. И., Дубровская И. С., Кваша О. П. и др. Численные методы. – М.: Высшая школа, 1976.

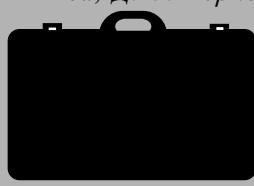
в портфеле редакции

в портфеле редакции

- Определение смежности компонентов. С. В. Зудин, С. Ю. Лузин, О. Б. Полубасов (Россия, С.-Петербург)

в портфеле редакции

- Методика разработки и исследование усилителя класса Е. В. Г. Крыжановский, А. Н. Рудякова, Д. В. Чернов (Украина, г. Донецк)



в портфеле редакции

в портфеле редакции

в портфеле редакции

- Организация процесса фотосчитываия спектральных распределений радиосигналов в акустооптическом анализаторе спектра. В. В. Данилов (Украина, г. Донецк)
- Влияние режима работы охлаждающего термоэлемента на показатели надежности термоэлектрического устройства. В. Ф. Мусеев, В. П. Зайков (Украина, г. Одесса)

в портфеле редакции

в портфеле редакции

в портфеле редакции

в портфеле редакции